

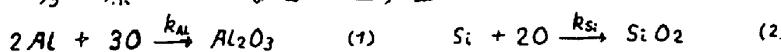
(62) Al-Si 复合脱酸の速度論的研究

東北大學 金研 ○坂上六郎 川崎千歳
鎌木いせ子 佐藤圭司

緒言 前報で Si-V 复合脱酸の結果を反応速度論的に解説し、 $Si + 20 \xrightarrow{k_{Si}} SiO_2$
 $2V + 30 \xrightarrow{k_V} V_2O_3$ 反応の速度常数比 k_V/k_{Si} ($10^3 \sim 10^5$) を求めたが、今回は Si-Al 脱酸について述べる。

実験方法 底より ~60 mm の位置に小孔を開いた石英サンプラーに、所定量の Si を装入し、A ガス気流下で、これを一定温度の溶鉄中に保持する。Si の溶融したところに Al を追加し、直ちにサシプラーを浸漬して、小孔より約 20 g の溶鉄を採取し、水中急冷した。このような採取法によって、Si, Al の溶鉄中の瞬間均一溶解をほぼ実現し、また均一組成の脱酸生成物を得ることができた。介在物は電解法によって抽出し、光度法によって定量する。種々の条件で行った結果を fig. 1 に示した。

考察 いま Al, Si の反応に対して、次の素過程を假定すると、



$$Al_2O_3, SiO_2 の生成に対して、それと水次式が導かれる。 \\ dC_{Al_2O_3}/dt = k_{AL} \cdot C_{AL}^2 \cdot C_0 \quad (3) \quad dC_{SiO_2}/dt = k_{Si} \cdot C_{Si} \cdot C_0^2 \quad (4)$$

$$\therefore \frac{dC_{Al_2O_3}}{dC_{SiO_2}} = \frac{k_{AL}}{k_{Si}} \cdot \frac{C_{AL}^2}{C_{Si}} \cdot C_0 = \frac{k_{AL}}{k_{Si}} \cdot \frac{(C_{AL}^0 - 0.530 C_{Al_2O_3})^2}{(C_{Si}^0 - 0.466 C_{SiO_2})} \cdot \frac{(C_0^0 - 0.47 C_{Al_2O_3} - 0.53 C_{SiO_2})}{0.53 C_{SiO_2}} \quad (5)$$

脱酸元素は反応開始から均一溶解していると

考えられるので、(5)の C_{AL}^0, C_{Si}^0 には Al, Si の添加量を代入することができ、さらに C_0, Al_2O_3, SiO_2 の分析値を利用して計算によって式中の k_{AL}/k_{Si} を求めることができる。その結果 Al, Si 濃度は無関係に、これが次のようにほぼ一定値となることを確認した。 $1600^\circ C$ $10^5 \sim 10^6$, $1675^\circ C$

さて (1), (2) または (3), (4) では逆反応の寄与を無視したが、逆反応の進行は実験方法、実験条件によって左右されると考えられ、正反応を表現したように普遍的な形で評価することはできない。この前の不満を補うため、種々の坩堝を使用し、A 雰囲気中で行った Si 脱酸の結果を fig. 2 にあげた。溶鉄の酸素富化によって FeO の浸透した（実験後の坩堝には ~10% の FeO が含まれる）

Al_2O_3 坩堝以外は、すべて Si 脱酸の平衡酸素値を考えて Ω の低下することが分った。 SiO_2 以外の坩堝を用いたとき、平衡値より Ω の低下する理由は、従来主として C_{SiO_2} の減少によって説明されてきたが、この現象はむしろ逆反応の寄与の度合によつて最低酸素値が決ってくるという立場から再検討してみる必要がある。またこれに関連して、 k_{AL}/k_{Si} が濃度に無関係に一定といふ事實は、最初の反応モデルが正当な可能性を裏付けているとも考えられ、これらの問題点をあわせて報告したい。

